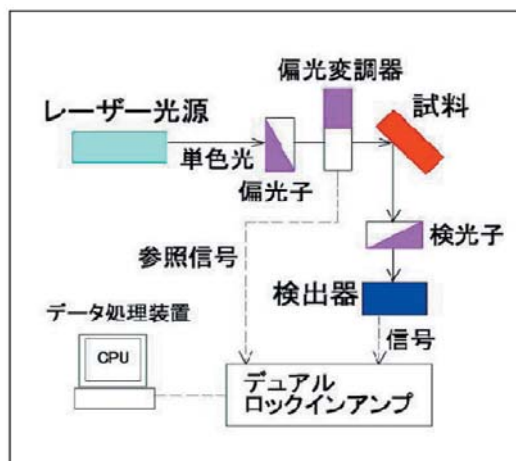


分光エリプソメーター

Spectroscopic Ellipsometer

日本分光製 M-220型



物質にレーザー光を照射し、その反射光の偏光特性を検出し、物質の屈折率や膜厚等の情報を得る

1. 機器名称 分光エリプソメーター
2. 機器分類 光学分析
3. 担当部署 理工学部 ナノ物質工学科
4. 装置担当者 河村 正昭
5. 導入年度 2004年
6. 型式 日本分光(株) M-220
7. 仕様・性能 光源;He-Ne レーザー(632.8nm),Xe ランプ(260カラ 60nm)、分光器;回折格子モノクロメーター、測定波長; 260~860nm、膜厚測定; 0~60,000Å、測定精度; 屈折率 (± 0.01)、膜厚 ($\pm 3\text{\AA}$)、消衰係数; (± 0.01)
8. 機器の開放状況 (該当する区分を選択して下さい。)
・ 共同利用のみ可
9. 利用上の注意点
10. 主な使用事例: 半導体の厚み解析、バイオセンサーの厚み変化観察など